科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月 20 日現在

機関番号: 1 3 1 0 1		
研究種目: 基盤研究(B)		
研究期間: 2011~2013		
課題番号: 2 3 3 6 0 0 7 5		
研究課題名(和文)レーザ走査干渉技術を用いたトライボ要素円筒表面ナノレベル観察装置の研究		
研究課題名(英文)Nanoscale measurement of cylinder surfaces of tribo-elements using a laser scanning interferometry with a wide field of view		
研究代表者		
新田 勇(NITTA, ISAMI)		
新潟大学・自然科学系・教授		
研究者番号:30159082		
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 14,000,000 円 、(間接経費) 4,200,000 円		

研究成果の概要(和文): 横方向空間分解能が高い広視野レーザ顕微鏡は,高さ方向の分解能は数µmにとどまって いる.そこで,高さ方向の分解能をnmレベルに向上させるた,レーザ光の位相を利用するできるように装置を改良した .試作した装置を用いてSUS304製円筒試験片の表面観察を行った.その結果,円筒面全面にわたり明瞭か干渉縞を得る ことに成功した.円筒の表面形状を決定するために,干渉縞の画像解析手法を開発した.その結果,円筒面の表面形状 を3次元表示することができた.これにより,短時間で円筒面全面の形状を計測する手法が開発できた.

研究成果の概要(英文): In a previous study, we have developed a new type laser microscope with a wide fi eld of vew. There is a trade-off between the resolution and the field of view. We sacrificed the resolutio n of the laser microscope in the depth direction to get the wide field of view. To achieve a nano-level me asurement of the whole shape of a cylindrical object, two-beam interferometry was introduced to the laser microscope with wide field of view. Among the various forms of interferometry, two-beam interferometry is especially simple and straightforward in principle, as well as practice, and is therefore utilized for a b road range of applications. In this work, we have acquired interference images of the whole cylinder surfa ce with the aid of a reference flat. As a result, fringe patterns over the whole cylinder surface could be obtained. From image processing of the fringe patterns, we calculated the surface profile of the cylinder on a nano scale.

研究分野:工学

科研費の分科・細目: 機械工学・設計工学,機械機能要素,トライボロジー

キーワード: トライボロジー 機械要素 円筒表面 欠陥検査 レーザ干渉 レーザ走査 ナノレベル シュリンク フィッタ

1.研究開始当初の背景

平面同士の接触においては,その表面に存 在する粗さやうねりの影響で,全面が均一に 接触しない.この事実が,トライボロジーに おける接触問題を複雑にしている.固体表面 の接触解析においては,表面微小突起先端の 存在確率密度関数を考慮する手法が一般的 である.しかし,計測時間の制約で表面全体 の形状を計測することはできず、接触面の一 部の計測データを基にした統計量を接触面 全体に適用する考え方が支配的である、その ため,確率論による予測値は,摩擦力にしろ, すきまからの漏れ速度にしろ , 定性的な予測 は可能でも,定量的な予測には至らなかった. このような不十分な解析に基づく予測値を 実験値に一致させるためには,実験定数なる ものが必要であった、筆者らはこの原因は、 表面のうねりを無視することにより生じて いると考えている.接触面の全面を観察する ことができれば,そこで生じている現象をこ れまで以上に正しく理解できるはずである. 既に,ゴムローラの接触面全面を観察する

ことにより、真実接触面積と摩擦力が比例す



図 1 広視野レーザ顕微鏡による円筒面観察 の概略図



図 2 SiC の鏡面を広視野レーザ顕微鏡の干渉 法で観察した例(観察領域 (4×4mm), (a) 干渉法を用いていない場合, (b)干渉法を用 いた場合, (c) TiN 表面を研磨したもの,上 下方向に研磨キズは見られるが,このよう に粗い面でも干渉編は出現する. ること,しかも紙粉が付着してもその関係が 変わらないことを明らかにした.また,金属 ガスケットの漏れ特性も,接触面の全面観察 により漏れ流路が特定でき,漏れ予測の精度 を向上することができた.これらの観察には, 広視野レーザ顕微鏡を使用した.広視野レー ザ顕微鏡の視野は,同倍率の光学顕微鏡に比 べて約 400 倍広いことから,これまでは計測 時間の点であきらめていた接触面全面の観 察が可能となる.

上記の平面観察の次に,観察難易度の高い 円筒面観察に挑戦した.広視野レーザ顕微鏡 は,レーザを水平方向に走査するので,水平 方向に設置した円筒面の母線に沿うように レーザを走査するようにすれば,円筒を一回 転させるだけで,その表面画像がひずみなく 取得できる(図 1).円筒面の全面観察は通常 の顕微鏡では難しく,報告例はほとんど存在 しない.申請者らは,これまでにエンドミル を含む各種の円筒の刃物や機械要素を観察 してきた.

さて, 広視野レーザ顕微鏡はレーザ走査型 の顕微鏡であり, 視野を広げるために高さ方 向の分解能を犠牲にしているところがある. そこで, レーザ干渉技術を組み込むことで, 高さ方向の分解能を向上させることを試み ている.一般的なレーザ干渉計は, 干渉縞の みを取得することに重点を置いている.これ に対して, 広視野レーザ顕微鏡は元来が顕微 鏡ということで, 表面画像に干渉縞を重ね合 わせて取得することができる.その例を図2 に示す.顕微鏡タイプの干渉計も存在するが, 視野が狭いので, 広い表面を観察するのは複 数回の計測が必要となる.計測時間が長くな ることや, ナノレベルで形状データをつなぎ 合わせることが難しい.

今回は円筒面のナノレベル形状計測を行うことを試みた.さらに,通常の測定では難しいとされるシリンドリカルレンズの計測 も試みた.

円筒面の形状計測の先行研究としては,通常の白色干渉計に円錐形の参照板を組み合わせる手法で,円筒の外径と内径を測定したものがある.この方法では,形状精度の高い円錐面を準備する必要があり,その形状が計測精度に強く影響を及ぼす欠点がある.

2.研究の目的

申請者は,独創的な広視野レーザ顕微鏡を 用いて,円筒面の全面を短時間で高精度に観 察できる手法を世界ではじめて開発した.こ の装置は広い視野を観察することを主眼と したシュリンクフィッタ技術援用レーザ走 査方式を用い,微細レーザスポット光の反射 光強度のみを利用している.そのため,横方 向の空間分解能は高いが,高さ方向の分解能 は数 µm にとどまっている.そこで,高さ方 向の分解能を向上させるために,レーザ光の 位相を利用する独自のレーザ走査干渉法を 用いることを立案した.これまでの高い横方

表1 広視野レーザ顕微鏡諸元

レーザ発振器	固体レーザ(488[nm])
視野 (平面観察時), mm²	10 × 8
解像度,μm	2.5
画素数, pixels	20000×16000
レーザ走査速度, Lines/min	9000

表 2 空気静圧軸受諸元

	半径方向	軸方向
軸受剛性	25 N/mm 以上	N/mm 以上
許容荷重	60 N	289 N
回転ふれ	20 nm 以下	20 nm 以下

①static pressure air bearing spindle 2observing specimen 3interference plate 4 laser microscope with wide field of view 5 motorized stage 6 (7 manual stages 8 rotary stage



図3 観察円筒試験片の支持方法.空気静圧軸 受で円筒面を保持している,参照板に対し て円筒は姿勢調整ができる.



図4 図3の外観写真

向分解能と併せて,高さ方向もnmレベルの 高分解能を実現できる画期的な観察装置の 開発を目指す.これにより,円筒面などの転 がり要素全面の表面形状を高い分解能で観 察する手法を実現することが研究目的であ る.

SUS304 cylinder

• 10mm in diameter • mirror surface by mechanical and electrolytic polishing

Cylindrical lens

 D-shaped surface
difficult to observe by conventional microscope
adhered to a special jig





図 5 観察に使用した 2 種類の試験片, 鏡面 加工した SUS 304 ステンレス丸棒 とシリ ンドリカルレンズ



図 6 ステンレス丸棒の観察結果, 観察領域 は長さ 31.4mm で幅 10mm

3.研究の方法

3.1 広視野レーザ顕微鏡の概要

使用した広視野レーザ顕微鏡のレーザ波 長は 488nm である.図1の光路図に示すよう に、レーザ発振器から射出されたレーザ光は コリメートされて,反射ミラーで直角方向に 偏向された後, 偏光ビームスプリッタと 1/4 波長板を通って,回転している平面ミラーに 導かれる.その後,印レンズを通り,円筒面 に集光する.円筒面で反射したレーザ光は, 往路を偏光ビームスプリッタまで戻り, 集光 レンズとピンホールを通り,受光素子に達す る. 受光素子の反射光強度は, 12 ビット A/D 変換器でデジタルデータに変換され,パソコ ンに取り込まれる. 各点毎の反射光強度を並 べ直すことで,ディスプレイ上に画像を構成 する.広視野レーザ顕微鏡の主な諸元を表1 に示す.広視野レーザ顕微鏡の平面ミラーは 空気動圧軸受で支持されているので,顕微鏡

のジッターは低い値に抑えられている.本研 究では2光束干渉の原理を利用した.円筒試 験片の手前に配置した参照板の裏面で反射 した光強度と円筒面表面で反射する光強度 が干渉するため,その光強度は両者の距離 h に対応して,余弦関数的に変化する.広視野 レーザ顕微鏡で使用しているレーザ光の半 波長変化する毎に暗い干渉縞が出現するこ とになる.

図3は広視野レーザ顕微鏡で2光束干渉を 使用するための参照板の配置を示している. 観察する円筒面に接するほど近づけて配置 している.円筒面の母線と参照板は平行にな らないと安定して干渉縞が生成できないの で,参照板の姿勢が調整できるように手動ス テージを取り付けている.

観察用の円筒は心ぶれなしで高精度に回転しないと安定した干渉縞が得られないので,その支持用軸受は空気静圧タイプのものを使用した.空気静圧軸受の諸元を表2に示す.半径方向の軸ぶれは20nm以内となっている.

図4は,広視野レーザ顕微鏡の反対側から 見た装置の外観である.空気静圧軸受にも姿 勢調整機構が備えられており,2軸方向のあ おりと,鉛直軸周りの回転ができるようにな っている.

3.2 観察用試験片

図 5 に円筒面観察用の試験片を示す. SUS304 円筒は,段付き円筒で直径の大きい 方を空気静圧軸受に取り付け,直径の小さい 10mm 部分を計測した.観察部分は,複合電 解研磨で鏡面に仕上げられている.シリンド リカルレンズは,平凸シリンダーレンズ



図7 干渉縞を等高線とするための画像処 理,2値化,細線化,ナンバリング, および等高線を元にした多項式近似



図8 干渉縞像から計算された円筒面の3次 元形状,中央部に深い谷が認められる



図9 干渉縞画像から計算された表面形状コ ンターマップを幾何学的に完全な円筒に巻 き付けて表示した図,円筒面形状がよりよ く理解できる,赤は高い所,青は低い所, 将来的には凹凸形状に合わせて円筒を変形 させて表示したい.

12.5×12.5×25 である. 平面部の寸法が 12.50mm×25.00mmであり,凸面の曲率半径が 12.92 mmである.シリンドリカルレンズの形 状測定は,専用の測定装置がほとんど存在せ ず難しいとされている.そのままでは計測で きないので,直径が12.92mmと同じ曲率半径 を持つ円筒の一部を切り欠いた治具を製作 し,その切り欠き部にシリンドリカルレンズ を接着した.

3.3 観察結果

SUS304 円筒の観察結果を図 6 に示す.円 筒面上の四角い枠で囲った部分を一周分観 察した.干渉編は,円筒の展開図として表示



図 10 シリンドリカルレンズの干渉縞計 測と,干渉縞から計算した表面形状, 理想的な円筒面から約 3µm 表面形状 が偏っている

した.展開図の横は 10mm で,縦は 31.4mm である.木目調の模様が干渉縞である.干渉 縞が密に生じているが,広視野レーザ顕微鏡 の横方向の分解能が高いために,細かな干渉 縞でも明瞭に識別できている.

図7は,干渉縞の分布を高さデータに変換 する方法である.干渉縞を等高線と考えて, 等高線間の高さを内挿関数で近似する手法 である.この手法では,観察画像を順に,二 値化,細線化,番号付けしていく.一枚の観 察画像は,横2万ピクセル,縦1万6千ピク セルであり,画像処理を行うには時間がかか った.求めた等高線の高さは既知であるので 多項式関数で近似できる.等高線間の高さは この関数で計算している.

図8は,このようにして求めた円筒面の形 状を3次元的に表示したものである.円筒面 中央部が約10µm 程度くぼんだ形状になって いる.

図9は,カラーチャートを円筒面に巻き付けて表示したものである.このように円筒面 に巻き付けて表示することで形状の理解が 進むことが分かる. 図 10 はシリンドリカルレンズの形状を計 測した部分を示すものである.四角の枠で囲 まれた部分を計測した.観察した干渉縞分布 を展開図として示す.主に縦方向に干渉縞が 観察された.所々で干渉縞が横方向に変化し ているところが認められる.これよりシリン ドリカルレンズの表面は,所々で数百 nm 程 度の凹凸が存在することが分かる.この干渉 縞を基にして求めた表面形状も示す.円筒面 全面に亘っておよそ 3µm の凸面形状である ことが分かる.

4. 研究成果

従来の顕微鏡に比べて約400倍広い視野を 持つ広視野レーザ顕微鏡を用いて,円筒面全 面のナノレベルの形状計測装置を試作した. 円筒面全面の干渉縞を取得し,その干渉縞を 解析することで,円筒面の高さ分布を求めて いる.金属円筒全面とシリンドリカルレンズ 全面を観察し,本手法がnmレベルの測定に 使用できることを確認した.これにより,本 研究の目的は達成された.

今回の計測では,干渉縞取得後にその縞解 析の画像処理はまだ完成度が低い.計測ハー ドウェア以外の画像処理ソフトウェアシス テムの完成度を上げることが今後の課題と なる.それに併せて,今後は計測精度につい て詳しく調べていく計画である.

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計1件)

<u>Isami Nitta</u>, Yosuke Tsukiyama, Tsuyoshi Tsukada, Hirotoshi Terao, Evaluation of tribological properties of pick up roller measured using a laser microscope with a wide field of view, Tribology International, 査読有, Vol.67 (2013) pp.182–190.

http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2013.07.014

〔学会発表〕(計2件)

1.佐久間俊介,関健作,月山陽介,<u>新田勇</u>, 広視野レーザ顕微鏡による円筒表面形状の ナノベル測定,2013年度精密工学会北陸信 越支部学術講演会(福井)講演番号 B07,2013 年11月23日発表.

2. 佐久間俊介,福島直幸,月山陽介,<u>新田</u> <u>勇</u>,広視野レーザ干渉計を用いた円筒形状の 高精度測定法の開発,日本トライボロジー学 会 トライボロジー会議 2013(東京)講演 番号 B35,2013年5月22日発表.

〔その他〕 ホームページ等 http://tribo.eng.niigata-u.ac.jp/

6.研究組織

(1)研究代表者
新田 勇(NITTA ISAMI)
新潟大学・自然科学系・教授
研究者番号: 30159082

(2)研究分担者

なし

(3)連携研究者 なし